(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-30710

(43)公開日 平成11年(1999)2月2日

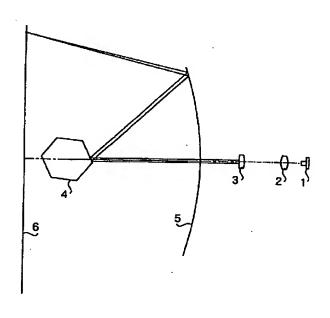
(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	FΙ			
G 0 2 B	5/10		G 0 2 B 5/1	10	Α	
					Z	
	26/10		26/1	10	E	
		103			103	
H04N	1/113		H04N 1/0	04	104A	
			審查請求	未請求 請求項	の数9 FD	(全 9 頁)
(21)出願番号	+	特顧平9-202246	(71)出願人 0	00000527 但光学工業株式:	会社	_
(22)出顧日		平成9年(1997)7月11日	Ţ	東京都板橋区前!	野町2丁目36都	\$9号
			J	板塚 隆之 東京都板橋区前! 学工業株式会社		\$9号 旭光
				炉理士 松岡		

(54) 【発明の名称】 反射型走査光学系

(57)【要約】

【課題】 偏向器より像側に1枚の曲面ミラーのみを用いた従来の走査光学系では、曲面ミラーが副走査方向にパワーを持たないため、設計の自由度が低く、良好な光学的性能を得ることが困難であるという問題がある。

【解決手段】 半導体レーザー1から発した光東をポリゴンミラー4により偏向して走査させ、偏向された光東を1枚の曲面ミラー5により走査対象面6上に結像させる。曲面ミラー5は、主走査、副走査の両方向の正のパワーを有し、ポリゴンミラー4から入射する光東を副走査方向に所定の分離角度 θ 2をもって反射させるよう配置される。曲面ミラー5の形状は、光軸を含む主走査方向の基準直線に対して副走査方向に非対称である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源から発した光束を偏向器により偏向 して走査させ、偏向された光束を1枚の曲面ミラーによ り走査対象面上に結像させる走査光学系において、 前記曲面ミラーは、主走査方向、副走査方向に正のパワ ーを有し、前記偏向器から入射する光束を副走査方向に 所定の分離角度をもって反射させるよう配置され、前記 曲面ミラーの形状は、光軸を含む主走査方向の基準直線 に対して副走査方向に非対称であることを特徴とする反 射型走查光学系。

【請求項2】 前記曲面ミラーは、主走査方向における*

$$0.005 < \left| \frac{\partial x}{\partial z} \right|_{(y=0.8P,z=0)} - \frac{\partial x}{\partial z} \right|_{(y=0,z=0)} < 0.025 \quad \cdots (1)$$

10

【請求項4】 前記曲面ミラーの x 軸方向のサグ量を表 す関数 f (y, z)が、yおよびzに関する二次元の多項 式で表現されることを特徴とする請求項3に記載の反射 型走査光学系。

【請求項5】 前記光源から発して前記偏向器に入射す る光束が主走査方向において平行光であることを特徴と する請求項3に記載の反射型走査光学系。

【請求項6】 前記光源から発して前記偏向器に入射す る光束が主走査方向において発散光であることを特徴と する請求項3に記載の反射型走査光学系。

【請求項7】 前記偏向器はポリゴンミラーであり、そ の反射面が曲面であることを特徴とする請求項3に記載 の反射型走査光学系。

【請求項8】 前記ポリゴンミラーの反射面は、主走査 方向に曲率を有するシリンドリカル面であることを特徴 とする請求項7に記載の反射型走査光学系。

【請求項9】 前記偏向器から前記曲面ミラーまでの距 離をp、前記曲面ミラーの近軸における主走査方向の実 効上の曲率半径を rm'として、以下の条件(2)を満たす ことを特徴とする請求項3に記載の反射型走査光学系。 0. $2 < |p/rm'| < 0.4 \cdots (2)$

ただし、rmiは、前記曲面ミラーのx軸方向のサグ量を 表す関数 f(y, z)が、yおよびzに関する二次元の多 項式で表現され、この多項式のyの二乗に関する係数を A2、曲面ミラーの近軸における主走査方向の曲率半径 をrmとして、1/rm'=1/rm+2A2により求めら れる。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、レーザープリン タ等の装置に使用される走査光学系に関し、特に、偏向 器より像面側に1枚の曲面ミラーのみを配置した反射型 走査光学系に関する。

[0002]

【従来の技術】この種の反射型走査光学系は、例えば特

*光軸からの距離に応じて副走査方向における入射角度が 変化するよう形成されていることを特徴とする請求項1 に記載の反射型走査光学系。

【請求項3】 主走査方向にy軸、副走査方向にz軸、 これら2軸に直交するx軸からなる三次元座標を設定 し、前記曲面ミラーの形状を表すy-z平面からのx軸 方向のサグ量が、y座標、z座標の関数f(y,z)とし て表される際に、前記偏向器から前記曲面ミラーまでの 距離をpとして、以下の条件(1)を満たすことを特徴と する請求項1に記載の反射型走査光学系。

【数1】

に開示される走査光学系では、光源から発する光束がこ の光束と同一面内でポリゴンミラーにより反射、偏向さ れ、曲面ミラーにより走査方向と交差する方向に反射さ れて感光ドラムに達する。曲面ミラーの形状は、感光体 ドラム上で光束が直線的な軌跡を描くように、ミラーの 光走査方向の湾曲を考慮して中央から周辺に向かい入射 角度が徐々に大きくなるよう形成されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た公報に開示される走査光学系では、その第2図に示さ れるように曲面ミラーが副走査方向の面内ではパワーを 持たないため、設計の自由度が低く、良好な光学的性能 を得ることが困難であるという問題がある。すなわち、 1枚の曲面ミラーに通常の走査光学系で利用される f θ レンズに代わる機能を持たせるためには、少なくとも曲 面ミラーには f θ 特性を実現するための歪曲収差、主走 査方向、副走査方向の像面湾曲補正効果を持たせる必要 がある。また、ポリゴンミラーを用いる場合にはその面 倒れ誤差(反射面の副走査方向の傾き誤差)を補正するた めの機能も要求される。このうち、少なくとも副走査方 向の像面湾曲と面倒れ誤差との補正のためには曲面ミラ ーが副走査方向にもパワーを持つことが必須となる。

【0004】この発明は、上述した従来技術の課題に鑑 みてなされたものであり、1枚の曲面ミラーで良好な光 学的性能を得ることができる反射型走査光学系を提供す 40 ることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明にかかる反射型 走査光学系は、上記の目的を達成させるため、光源から 発した光束を偏向器により偏向して走査させ、偏向され た光束を1枚の曲面ミラーにより走査対象面上に結像さ せる走査光学系において、曲面ミラーに主走査、副走査 の両方向の正のパワーを持たせ、偏向器から入射する光 束を副走査方向に所定の分離角度をもって反射させるよ う配置し、曲面ミラーの形状を、光軸を含む主走査方向 開昭62-253116号公報に開示される。この公報 50 の基準直線に対して副走査方向に非対称としたことを特

徴とする。

【0006】曲面ミラーは、主走査方向にy軸、副走査 方向に z 軸、これら 2 軸に直交する x 軸からなる三次元 座標を設定し、曲面ミラーの形状を表すy-z平面から のx軸方向のサグ量が、y座標、z座標の関数f(y,

* z)、例えばyおよびzに関する二次元の多項式、とし

$$0.005 < \left| \frac{\partial x}{\partial z} \right|_{(y=0.8P,z=0)} - \frac{\partial x}{\partial z} \left|_{(y=0,z=0)} \right| < 0.025 \quad \dots (1)$$

20

【0007】光源から発して偏向器に入射する光束は、 主走査方向において平行光、あるいは発散光である。偏 向器はポリゴンミラーであり、その反射面は平面または 主走査方向に曲率を有するシリンドリカル面である。

【0008】また、偏向器から曲面ミラーまでの距離を p、曲面ミラーの近軸における主走査方向の実効上の曲 率半径を rm'として、以下の条件(2)を満たすことが望 ましい。

 $0.2 < |p/rm'| < 0.4 \cdots (2)$

ただし、rm'は、曲面ミラーのx軸方向のサグ量を表す 関数 f(y, z)が、yおよびzに関する二次元の多項式 で表現され、この多項式のyの二乗に関する係数をA 2、曲面ミラーの近軸における主走査方向の曲率半径を rmとして、1/rm'=1/rm+2A2により求められ る。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、この発明にかかる走査光学 系の実施形態を説明する。実施形態の走査光学系は、例 えばレーザープリンターの走査光学系として利用され る。実施形態の走査光学系は、例えば図1、図2に示す ように構成される。図1は主走査方向の説明図、図2は その副走査方向の説明図である。

【0010】光源である半導体レーザー1から発した光 束は、コリメートレンズ2により平行光とされ、副走査 方向にのみ正のパワーを有するシリンドリカルレンズ3 により副走査方向に収束されて偏向器であるポリゴンミ ラー4に入射する。ポリゴンミラー4の反射面により反 射された光束は、結像光学系としての曲面ミラー5によ り反射され、感光体ドラム等の走査対象面 6 上にビーム スポットを形成する。ビームスポットは、ポリゴンミラ 一4の回転に伴って走査対象面6上を主走査方向に走査 する。

【0011】なお、この明細書では、「光学系の光軸」 は、走査対象面6上のスポットが走査中心に達する際の 光束の主光線に一致する軸として定義される。また、

「主走査方向」は、光学系の光軸に垂直な面内において 走査対象面上でのスポットの走査方向に相当する方向、

「副走査方向」は光学系の光軸に垂直な面内において主 走査方向に直交する方向として定義される。

【0012】シリンドリカルレンズ3は、コリメートレ ンズ2側のレンズ面が副走査方向にのみ正のパワーを持 つシリンダー面、ポリゴンミラー4側のレンズ面が平面 50

として構成されている。シリンドリカルレンズ3のパワ 10 ーは、シリンドリカルレンズ3により形成される線像が ポリゴンミラー4の反射面の近傍に位置するよう定めら れている。

> 【0013】ポリゴンミラー4は、半導体レーザー1側 から入射する光束を副走査方向に第1の分離角度 θ1を もって反射させるよう配置されている。ポリゴンミラー 4で反射された光束は、主走査方向にはほぼ平行光とし て、副走査方向には強い発散光として曲面ミラー5に入 射する。曲面ミラー5のミラー面は、主走査方向、副走 査方向共に正のパワーを有しており、光束を走査対象面 6上に収束させる。

> 【0014】曲面ミラー5は、ポリゴンミラー4から入 射する光束を副走査方向に第2の分離角度θ2をもって 反射させるよう配置されている。 曲面ミラー5の形状 は、光軸を含む主走査方向の基準直線に対して副走査方 向に非対称である。光束が副走査方向に所定の分離角度 を持って曲面ミラーに入射する場合、曲面ミラー上での 光束の軌跡は湾曲する。このため、曲面ミラーが基準直 線に対して副走査方向に非対称であると、曲面ミラーに 対する光束の副走査方向における入射角度が主走査方向 における光軸からの距離に応じて変化する。この変化に より、走査線湾曲を補正することができる。

> 【0015】f θ特性の補正は、曲面ミラーへの入射角 度とビームスポットの走査中心からの距離とがほぼ比例 するようにすることで、これは主走査方向に負の歪曲収 差を与えることにより実現できる。面倒れ誤差は、光束 を副走査方向においてポリゴンミラー4上で結像させる と共に、ポリゴンミラーのミラー面と走査対象面6とを ほぼ共役にすることにより補正することができる。この ためにシリンドリカルレンズ3が設けられており、曲面 ミラー5は副走査方向に強い正のパワーを有している。

> 【0016】曲面ミラーの形状は、主走査方向にy軸、 副走査方向にz軸、これら2軸に直交するx軸からなる 三次元座標を設定し、y-z平面からのx軸方向のサグ 量を、y座標、z座標の関数f(y,z)として表すこと により規定される。関数 f(y, z)は、yおよびzに関 する二次元の多項式で表現される。実施形態の曲面ミラ 一は、偏向器から曲面ミラーまでの距離をpとして、以 下の条件(1)を満たす。

【数3】

40

$$0.005 < \left| \frac{\partial x}{\partial z} \right|_{(y=0.8P,z=0)} - \frac{\partial x}{\partial z} \right|_{(y=0,z=0)} < 0.025 \quad \cdots (1)$$

【0017】条件(1)のxのzによる偏微分の項は、曲 面ミラー5の副走査方向の傾きを表し、したがって、条 件(1)は、y=0 (軸上)での傾きとy=0.8P (周辺部)で の傾きとの差、すなわち曲面ミラーのねじれの量を規定 する。条件(1)を満たす場合に、走査線の湾曲を小さく 抑えることができる。

*【0018】曲面ミラー5の形状(サグ量x)を表す関数 f(y, z)は、以下の式(A)で表される。ただし、式中 の記号 c は曲面ミラーの光軸上での主走査方向の曲率(1 /ry)、Kは円錐形数である。

【数4】

$$x = f(y,z) = \frac{c(y^2 + z^2)}{1 + \sqrt{1 - (K + 1)c^2(y^2 + z^2)}} + \sum_{n=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (A)$$

【0019】ここで、上記の式(A)の右辺を以下の式 (B), (C) のように二分する。

【数5】

$$xa = \frac{c(y^2 + z^2)}{1 + \sqrt{1 - (K + 1)c^2(y^2 + z^2)}} \cdots (B)$$

$$xb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,n} \cdot y^m \cdot z^n \cdots (C)$$

$$zb = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{m$$

%【0020】x=xa+xbであるため、以下の式(D) が成立する。

【数6】

$$\frac{\partial x}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} xa + \frac{\partial}{\partial z} xb \quad \cdots (D)$$

【数7】

$$\frac{\partial}{\partial z} xa = \frac{2cz}{1 + \sqrt{1 - (K + 1)c^{2}(y^{2} + z^{2})}} - \frac{(y^{2} + z^{2})(K + 1)c^{3}z}{\sqrt{1 - (K + 1)c^{2}(y^{2} + z^{2})} \left\{ 1 + \sqrt{1 - (K + 1)c^{2}(y^{2} + z^{2})} \right\}^{2}} \cdots (E)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} xb = \sum_{i} \sum_{m,n} B_{m,n} \cdot y^{m} \cdot nz^{n-1} \cdots (F)$$

【0022】上記の式(E)でz=0の場合、すなわち光 軸を通る基準直線上では、式(E)の値は0であるため、 傾き(xのzによる偏微分)を求めるためには第2項(xb の z による偏微分) のみを考慮すれば足りる。したがっ て、この場合、傾きは以下の式(G)により求められる。 【数8】

$$\frac{\partial x}{\partial z} = \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,1} \cdot y^m \cdots (G)$$

【0023】また、実施形態の光学系は、ポリゴンミラ ー4から曲面ミラー5までの距離をp、曲面ミラー5の 近軸における主走査方向の実効上の曲率半径をrmとし て、以下の条件(2)を満たす。

 $0.2 < |p/rm'| < 0.4 \cdots (2)$

ただし、rm'は、曲面ミラーのx軸方向のサグ量を表す 関数 f(y, z)が、yおよびzに関する二次元の多項式 で表現され、この多項式の y の二乗に関する係数をA2 (=B2,0)、曲面ミラーの近軸における主走査方向の曲

率半径をrmとして、1/rm'=1/rm+2A2により 求められる。

【0024】条件(2)は、曲面ミラーの位置とその曲率 半径との関係を規定したものである。主走査方向の走査 幅を一定とすると、ポリゴンミラーから曲面ミラーまで の距離Pが長いほど曲面ミラーのサイズは大きくなるた め、光源から曲面ミラーまでの光学系を小型化するため 40 には、間隔Pは小さいほど望ましい。一方、光学的な性 能面から考えると、曲面ミラーの主走査方向の幅が大き いほど曲面ミラーによる収差補正の自由度は大きくなる ため、間隔Pは大きい方が望ましい。条件(2)を満たす ことにより、小型化と良好な性能とを両立させることが できる。条件(2)の下限を下回る場合には、良好な性能 が得られず、上限を越える場合には、光学系全体が大型 化する。

【0025】間隔Pが比較的長い場合、曲面ミラー5へ の入射光は一般的な f θ レンズを用いる場合と同様に平 50 行光とすることができる。この場合、曲面ミラー5の主

走査方向のパワーは、平行光を走査対象面上に収束させ る作用と収差補正作用とを全て負担することとなる。間 隔Pが短くなると、曲面ミラーが主走査方向において平 行光を走査対象面上に収束させるパワーを持つのみでは 収差の補正が困難となる。そこで、このような場合に は、曲面ミラーに入射する光束を発散光とし、平行光を 収束させるより強い正のパワーを曲面ミラーに持たせる ことができる。

【0026】曲面ミラーに入射する光束を発散光とする ためには、上記のシリンドリカルレンズに代えて主走査 10 方向に負のパワーを持つトーリックレンズを用いる構 成、ポリゴンミラーのミラー面を主走査方向に負のパワ ーを持つ円筒面とする構成が採用できる。

[0027]

【実施例】以下、上述した実施形態の要件を満たす具体 的な実施例を3例説明する。実施例1は、描画性能を重 視してポリゴンミラーから曲面ミラーまでの距離Pを比 較的長く設定した例、実施例3はコンパクトさを重視し て上記の距離Pを比較的短く設定した例、そして、第2 の実施例はこれらの中間を示す例である。なお、すべて 20 の実施例において、光軸上でのポリゴンミラーにおける 第1の分離角度 θ 1は4.0°、曲面ミラーにおける第 2の分離角度 θ 2は 7.0°である。

[0028]

【実施例1】図1は、実施例1にかかる反射型走査光学 系の主走査方向の説明図、図2はその副走査方向の説明 図である。実施例1の光学系は、半導体レーザー1、コ リメートレンズ2、シリンドリカルレンズ3、ポリゴン*

> Bon.n n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 0.00 0.00 -2. 93E-03 0. 00 2. 60E-07 m=0m= 2 -8.77E-06 3.14E-06 -6.70E-08 0.00 1.80E-11 m= 4 7.80E-09 -2.50E-10 1.60E-12 0.00 0.00 m= 6 -5.18E-13 1.36E-13 -1.70E-16 0.00 0.00 1. 04E-16 -2. 50E-17 -2. 10E-19 0.00 0.00 m=10 -7. 12E-21 1. 49E-21 3. 40E-23 0. 00 0.00 m=12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

【0034】図3は、実施例1の構成による反射型走査 光学系の(A)直線性誤差、(B)主走査方向、副走査方向の 像面湾曲、(C) 走査線の副走査方向の湾曲を示す。各グ ラフの縦軸は像高(描画面5での光軸からの主走査方向 の距離)、横軸は各収差の発生量であり、単位は全てm mである。

[0035]

【実施例2】図4は、実施例2にかかる反射型走査光学 系の主走査方向の説明図、図5はその副走査方向の説明 図である。実施例2の光学系は、半導体レーザー1、コ リメートレンズ2、トーリックレンズ3a、ポリゴンミ ラー4、曲面ミラー5aから構成されている。この例で は、トーリックレンズ3 a が主走査方向に弱い負のパワ ーを有する。したがって、曲面ミラー5aへの入射光は 50 面番号

*ミラー4、曲面ミラー5から構成され、曲面ミラー5へ の入射光は主走査方向においては平行光、副走査方向に おいては発散光である。

【0029】表1は、実施例1にかかる反射型走査光学 系のシリンドリカルレンズ3より走査対象面6側の構成 を示している。表中の記号 ryは主走査方向の曲率半 径、rzは副走査方向の曲率半径、dは面間の光軸上の 距離、nは波長780nmでの屈折率である。

【0030】表中、面番号1、2がシリンドリカルレン ズ3、面番号3がポリゴンミラー4、面番号4が曲面ミ ラー5を示す。表1における曲面ミラーの主走査方向の 曲率半径 ryは、光軸上の曲率半径である。

【0031】曲面ミラー5の形状は、前述の式(A)によ り規定される。実施例1では、式(A)中の円錐係数K= O、曲率 c=1/ry=-3.69E-03であり、係数 Bm, n の値は表 2に示される。なお、表記Eは、10を基数、Eの右の数字 を指数とする累乗を表しており、例えば前記の曲率の値 「-3.69E-03」は「-0.00369」を意味する。

[0032]

【表1】

面番号	; ry	r Z	d	n
1	∞	55. 424	2.000	1. 48617
2	∞	∞	113.000	
3	∞	∞	84. 000	
4	-270. 910	*	135. 455	
【00 【表2	33] :]			

主走査方向においては弱い発散光、副走査方向において は強い発散光である。

【0036】表3は、実施例2にかかる反射型走査光学 40 系のトーリックレンズ3aより走査対象面6側の構成を 示す。表中、面番号1、2がトーリックレンズ3a、面 番号3がポリゴンミラー4、面番号4が曲面ミラー5 a を示す。

【0037】曲面ミラー5aの形状は、前述の式(A)に より規定される。実施例2では、式(A)中の円錐係数K= O、曲率 c=1/ry=-4.38E-03であり、係数 Bm, n の値は表 4に示される。

[0038]

【表3】

rу rΖ d

特開平11-30710

			9						10
1	-80. 000	55. 424	2.000	1. 48617	*	4 -	228. 200	*	169. 547
2	∞	∞	113.000			[003	3 9]		
3	∞	∞	70.000		*	【表 4 】			
		B _m , n	n=0	n=1	n=2	n=3	n=4		
		m= 0	0.00	0.00	-2. 80E-03	0.00	-5. 20E-07		
		m= 2	-1.30E-05	3.80E-06	-7. 20E-08	0.00	-3. 00E-11		
		m= 4	1.80E-08	1. 20E-10	7. 60E-12	0.00	-1. 40E-14		
		m= 6	-6. 00E-13	-8. 80E-14	1. 30E-15	0.00	-7. 00E-19		
		m= 8	2. 50E-16	2. 50E-17	-2. 10E-18	0.00	2. 30E-21		
		m=10	-5. 00E-20	-2. 60E-21	3. 90E-22	0.00	0.00		
		m=12	3. 50E-24	0.00	0. 00	0.00	0. 00		

【0040】図6は、実施例2の構成による反射型走査 光学系の(A) 直線性誤差、(B) 主走査方向、副走査方向の 像面湾曲、(C) 走査線の副走査方向の湾曲を示す。

[0041]

【実施例3】図7は、実施例3にかかる反射型走査光学 系の主走査方向の説明図、図8はその副走査方向の説明 図である。実施例3の光学系は、半導体レーザー1、コ リメートレンズ2、トーリックレンズ3 b、ポリゴンミ ラー4a、曲面ミラー5bから構成されている。この例 20 では、トーリックレンズ3bが主走査方向に弱い負のパ ワーを有すると共に、ポリゴンミラー4aのミラー面が 主走査方向に負のパワーを持つシリンドリカル面として 形成されている。したがって、曲面ミラー56への入射 光は主走査方向においては弱い発散光、副走査方向にお いては強い発散光となる。

【0042】表5は、実施例3にかかる反射型走査光学 系のトーリックレンズ3bより走査対象面6側の構成を※ ※示す。表中、面番号1、2がトーリックレンズ3b、面 番号3がポリゴンミラー4a、面番号4が曲面ミラー5 bを示す。

【0043】曲面ミラー5bの形状は、前述の式(A)に より規定される。実施例3では、式(A)中の円錐係数K= O、曲率 c=1/ry=-4.96E-03であり、係数 Bm, n の値は表 6に示される。

[0044]

【表5】

面番号	r y	гZ	d	n
1	-85. 100	55. 958	2.000	1. 48617
2	∞	∞	113, 000	
3	600.000	∞	60.000	
4	-201. 750	*	196. 490	
[00	45]			

【表 6】

Bm, n	n=0	n=1	n=2	n=3	n=4
m= 0	0.00	0.00	-2. 97E-03	8. 25E-06	5. 10E-07
m= 2	-1. 60E-05	3. 90E-06	-7. 99E-08	4. 05E-09	7. 00E-11
m= 4	3. 10E-08	1. 40E-09	-1. 24E-12	-1. 10E-12	1. 00E-14
m= 6	-8. 20E-13	-9. 50E-13	2. 40E-14	-6. 30E-16	2. 00E-17
m= 8	4. 00E-16	3. 00E-16	−1. 55E−17	3. 70E-19	1. 40E-20
m=10	-1. 20E-19	-3. 60E-20	2. 82E-21	0. 00	0.00
m=12	1. 25E-23	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

【0046】図9は、実施例3の構成による反射型走査 光学系の(A)直線性誤差、(B)主走査方向、副走査方向の 像面湾曲、(C) 走査線の副走査方向の湾曲を示す。

【0047】次に、上述した各実施例と条件(1)との関 係を表7、条件(2)との関係を表8に示す。いずれの実 施例も、条件(1), (2) を満たしている。

P ∂ 条件(1) 0.8P 実施例1 67.2 0.017 84 実施例2 70 **56.0** 0.012 実施例3 60 48.0 0.011

[0049] 【表8】

[0048]

【表7】

B (2, 0) |P/rm'| r m' -8. 77E-06 -269. 629 0.312

実施例1 -270. 910 実施例 2 -228.200 -1. 30E-05 -226. 854 0.309 -1.60E-05 -200.456 実施例3 -201.750 0.299

r

[0050]

ば、曲面ミラーに主走査、副走査の両方向において正の

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ

50 パワーを持たせると共に、その形状を光軸を通る基準直

11

線を境に副走査方向に非対称とすることにより、偏向器 より像面側に1枚の曲面ミラーを用いるのみで良好な光 学的性能を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1の反射型走査光学系の主走査方向の 説明図である。

【図2】 実施例1の反射型走査光学系の副走査方向の 説明図である。

【図3】 実施例1の反射型走査光学系の(A)直線性誤差、(B)主走査方向、副走査方向の像面湾曲、(C)走査線 10の副走査方向の湾曲を示すグラフである。

【図4】 実施例2の反射型走査光学系の主走査方向の 説明図である。

【図5】 実施例2の反射型走査光学系の副走査方向の 説明図である。

【図6】 実施例2の反射型走査光学系の(A)直線性誤

12 差、(B) 主走査方向、副走査方向の像面湾曲、(C) 走査線 の副走査方向の湾曲を示すグラフである。

【図7】 実施例3の反射型走査光学系の主走査方向の 説明図である。

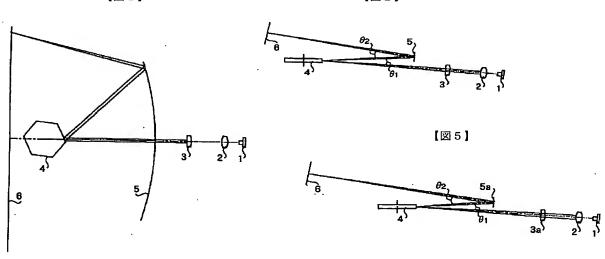
【図8】 実施例3の反射型走査光学系の副走査方向の 説明図である。

【図9】 実施例3の反射型走査光学系の(A)直線性誤差、(B)主走査方向、副走査方向の像面湾曲、(C)走査線の副走査方向の湾曲を示すグラフである。

10 【符号の説明】

- 1 半導体レーザー
- 2 コリメートレンズ
- 3 シリンドリカルレンズ
- 4 ポリゴンミラー
- 5 曲面ミラー
- 6 走查対象面

【図1】 【図2】

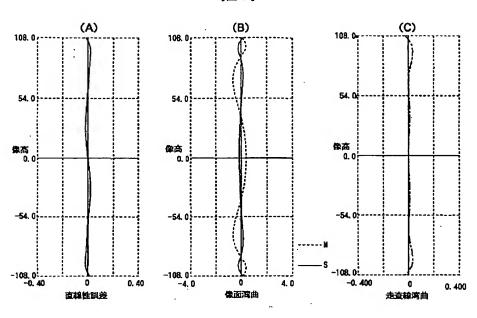


[図 4]

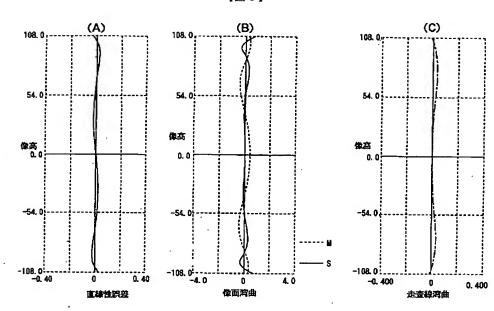
[図 4]

(図 7]

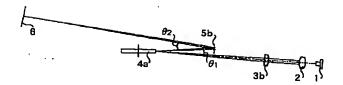
【図3】



【図6】



【図8】



0. 400

【図9】

